

試作装置見学室 (自作装置によるCMOSLSIの設計試作)

研究評価のパラメーターは  
“研究成果 ÷ 研究費用”

KEY  
PERSON

東北大学教授 (未来科学技術共同研究センター)

江刺正喜氏

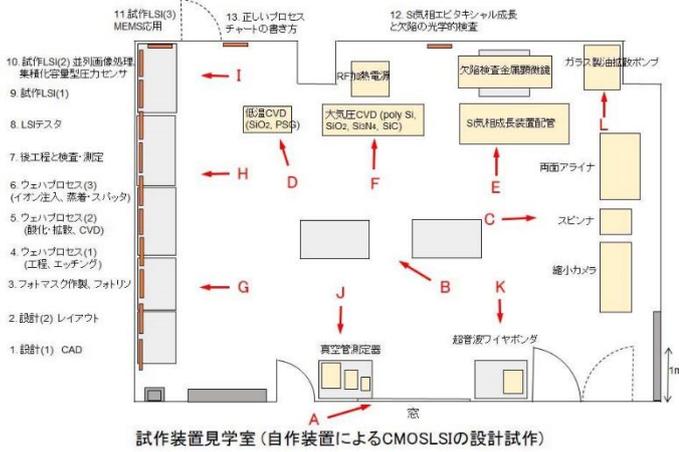


■ 江刺正喜 東北大学教授

創造性を発揮させるコラボレーション  
組織の活力はあらゆる管理・運営から生まれる

IBM USERS

1998-12/No.440



A. 廊下の窓から見た試作装置見学室



B. パネル(自作装置による CMOSLSI の設計製作)



C. 両面アライナ、スピナ、縮小カメラ



D. 低温 CVD 装置( $\text{SiO}_2$ , PSG)



E. Si 気相成長装置配管と干渉型金属顕微鏡(裏側)



F. 大気圧 CVD 装置(poly Si,  $\text{Si}_3\text{N}_4$ ,  $\text{SiO}_2$ )と加熱用 RF 電源(裏側)



G. 設計、フォトマスク作製



H. ウェハプロセス、後工程



I. テスト、試作 LSI



J. 真空管製測定器



K. 超音波ワイヤボンダ



L. ガラス製油拡散ポンプ